

薄膜沉积

在沉积过程中进行稳定和精确的气体控制

薄膜和涂层工艺需要稳定、可重复的条件以及对前体气体的精确控制。这对许多应用至关重要，包括太阳能电池生产、玻璃和透镜涂层、工具保护和半导体器件制造。盛思锐的SFC5500是半导体级质量流量控制器，用于控制工艺气体，可提供多气体校准、高精度和快速响应时间。

目标客户:

- 表面涂层系统制造商 (例如玻璃、太阳能电池或半导体晶圆)



SFC5500
50 sccm, 0.5 slm,
2 slm, 10 slm, 200 slm

应用挑战

- 1 需要一致且可重复的过程来加强控制并提高生产产量
- 2 先进工艺需在气体之间进行高速切换
- 3 同一过程中使用多种气体



盛思锐解决方案

- 1 绝佳的可重复性-通常优于常规方案10倍
- 2 最短稳定时间
- 3 多气体校准 (列表)

盛思锐解决方案:



拥有最佳性能SFC5500多功能质量流量控制器

Size (LxWxH): 105 x 38.5 x 90.5 mm³

其他优势

- 提供质量流量计和质量流量控制器两种版本
- 多个标准接头和通信接口选项
- 半导体级相容性

其他应用

- 分析仪器
- 过程控制
- FOUP

FAQs

- 与哪些标准接头兼容?

Downmount, Swagelock, Push-in, VCR, VCO

- 有哪些可用的通信接口?

RS485, DeviceNet, IO-link

- 质量流量控制器是否需要定期校准?

不需要, 与传统质量流量控制器不同, CMO-Sense质量流量控制器不会出现性能偏差, 也无需重新校准。

- SFC5500的工作压力范围?

根据流量范围确定, 最高可达10巴。

- 有哪些触液材料?

铝、黄铜阀门、密封聚合物和硅片。

- 质量流量控制器的性能是否受到温度和压力的影响?

质量流量控制器具有温度补偿功能。轻微的压力影响, 规格参数中已包含。

新手入门



EK-F5x evaluation kit

有用文档



Datasheets, application notes, handling instructions, samples codes, step files, certificates

相关传感器

- SFM5xxx gas flow sensor
- SFM6xxx gas flow sensor
- SFC6xxx mass flow controller